

А. П. КОЛЬЧЕНКО, А. Г. НИКИТЕНКО, Ю. В. ТРОИЦКИЙ
(*Новосибирск*)

**ДИНАМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛАЗЕРА
ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРИ — ПЕРО
С НЕРАВНОМЕРНЫМ ПРОПУСКАНИЕМ**

Для оптической связи, локации, а также для некоторых других применений лазеров важным является вопрос о методах формирования диаграммы направленности (ДН) лазера и управления ДН в динамическом режиме. В настоящее время разработаны достаточно эффективные методы управления оптическим лучом, основанные на принципах адаптивной оптики (см., например, обзор [1]). Вместе с тем нельзя не отметить, что практическое использование адаптивных устройств (сегментированные зеркала и т. п.) сильно ограничено ввиду их сложности и высокой стоимости. Они находят применение главным образом в астрономических исследованиях. В этой связи представляется целесообразным обсуждение других, более доступных средств и методов управления пространственными характеристиками лазерного луча.

В настоящей работе изучается метод управления ДН лазера, который может оказаться хорошим дополнением к уже существующим и использующимся в тех случаях, когда необходимо радикально менять форму ДН путем изменения одного параметра. Предлагаемый метод основан на пространственной амплитудно-фазовой модуляции лазерного пучка, при которой модулируется разность фаз и амплитуд полей двух (или более) частей пучка, расположенных в одном и том же поперечном сечении. Важным достоинством метода является то, что пучок не диафрагмируется, и поэтому практически отсутствуют дополнительные потери мощности лазера, вносимые модулирующим элементом.

В качестве примера рассмотрим частный случай светового пучка, соответствующего пиззей гауссовой моде, у которого внутренняя часть

(радиусом a) имеет другую амплитуду и фазу по сравнению с периферийной. Такой пучок может быть реализован при помощи плоскопараллельного интерферометра Фабри — Перо (ИФП) (рис. 1, *a*), состоящего из однородного зеркала 4 с энергетическим пропусканием T_1 и зеркала 5, выполненного в виде отражающего диска радиусом a с пропусканием T_2' , нанесенного на просветленную подложку. Этот интерферометр является выходным зеркалом лазера и

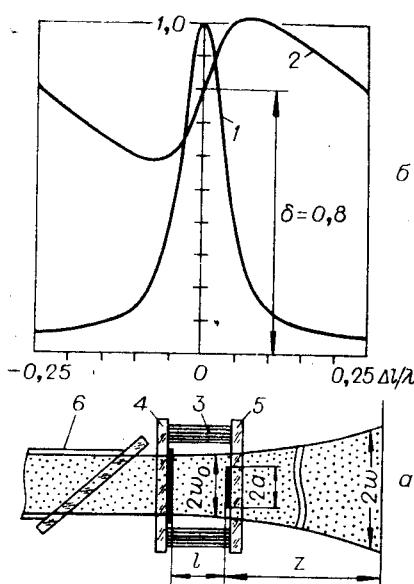


Рис. 1. Схема метода (а) и амплитудная и фазовая характеристики интерферометра (б):
1 — кривая пропускания интерферометра $T'(\Delta l)/T'(0)$ в центральной части, 2 — разность фаз между центральной и периферийной частями интерферометра $\Delta\beta$ в единицах π .

устанавливается однородным зеркалом в сторону активной среды 6 лазера. Размер отражающего диска меньше размера лазерного пучка в плоскости зеркала 5 ($a < w_0$). Очевидно, что центральная и периферийная части пучка после прохода интерферометра будут приобретать различные фазовые сдвиги и иметь различные амплитуды.

При изменении расстояния между зеркалами (пьезокерамикой 3 или электрооптическим кристаллом) на $\lambda/2$ амплитуда коэффициента пропускания такого интерферометра изменяется в соответствии с кривой 1 (см. рис. 1, б), а разность фаз коэффициентов пропускания для внутренней и внешней частей пучка — в соответствии с кривой 2. В результате на выходе интерферометра лазерный световой пучок оказывается пространственно промодулированным в поперечном сечении по амплитуде и фазе, причем глубина модуляции зависит от настройки интерферометра. При соблюдении определенных условий (эквифазность коэффициента отражения от ИФП изнутри резонатора [2]) следует ожидать, что изменение ДН будет происходить без заметных искажений поля в резонаторе.

Пусть лазер работает на низшей гауссовой mode, однородное зеркало ИФП имеет коэффициент пропускания по амплитуде τ_1 , а коэффициент пропускания зеркала 5 есть ступенчатая функция расстояния от оси пучка r

$$\tau_2(r) = \begin{cases} \tau'_2 = \sqrt{T'_2} \exp(i\beta'_2), & r \leq a, \\ \tau''_2 = \exp(i\beta''_2), & r > a, \end{cases}$$

где $T'_2 = |\tau'_2|^2$, β'_2 и β''_2 — фазы коэффициентов пропускания соответствующих частей зеркала. Коэффициент пропускания ИФП будет иметь, очевидно, аналогичную зависимость

$$\tau(r) = \begin{cases} \tau' = \sqrt{T'} \exp(i\beta'), & r \leq a, \\ \tau'' = \sqrt{T''} \exp(i\beta''), & r > a. \end{cases}$$

Здесь τ' и τ'' вычисляются по обычным формулам для плоского ИФП [3] и зависят от $\Delta l = l - l_0$, где l_0 — длина ИФП, при которой T' максимально.

С учетом изложенного для распределения интенсивности светового пучка лазера в дальней зоне получается выражение

$$I(r) \propto [e^{-\rho^2} - \epsilon Y(\rho)]^2 + [\mu Y(\rho)]^2, \quad (1)$$

$$\epsilon = 1 - \sqrt{\kappa} \cos \Delta \beta, \quad \mu = \sqrt{\kappa} \sin \Delta \beta, \quad \kappa = T'/T'',$$

$$\Delta \beta = \beta' - \beta'', \quad \rho = r/w, \quad w = \lambda z / \pi w_0.$$

Функция $Y(\rho)$ представляется в виде ряда [4]

$$Y(\rho) = e^{-\eta^2} \sum_{n=1}^{\infty} (\eta/\rho)^n J_n(2\eta\rho), \quad \eta = a/w_0. \quad (2)$$

В этих формулах w_0 , w — параметры гауссова пучка соответственно на входе ИФП и в дальней зоне, J_n — функция Бесселя.

Из (1) и (2) следует, что свойства $I(r)$ определяются тремя параметрами: относительным пропусканием двух частей ИФП κ , разностью фаз $\Delta \beta$ и относительным размером отражающего диска. Величины κ и $\Delta \beta$ в зависимости от пропусканий зеркал истройки Δl могут меняться в широких пределах, так что в общем случае $I(r)$ будет иметь различный вид.

Анализ общих выражений (1), (2) и числовые расчеты показывают, что наибольшие вариации формы $I(r)$ при изменении Δl получаются в

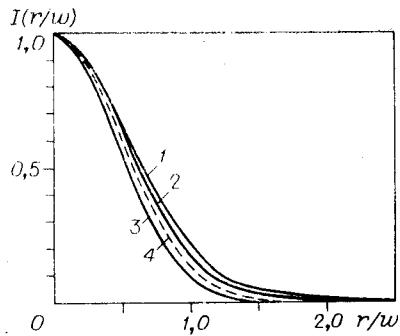


Рис. 2. Распределение интенсивности в дальней зоне в поперечном сечении пучка для разных значений Δl

(случай $\eta=0,5$; $\delta=0$; $T_1=0,025$; $T_2'=0,6$):
1 — $\Delta l=0$, 2 — $\Delta l=0,0367 \lambda$, 3 — $\Delta l=0,25 \lambda$,
4 — гауссово распределение.

том случае, если $\delta \approx \pi$. Напротив, при $\delta \ll \pi$ соответствующие изменения невелики.

На рис. 2 и 3 приводятся две серии графиков, рассчитанные по формуле (1) и соответствующие указанным двум ситуациям. На каждом из рисунков разные кривые отвечают разным значениям Δl . Штриховые кривые — гауссово распределение $\exp(-2\rho^2)$, которое получается в отсутствие неоднородности коэффициента пропускания ИФП ($\chi=1$, $\Delta\beta=0$). Все кривые нормированы на максимальное значение. Для случая, соответствующего рис. 2, $\delta=0$, и поэтому $\Delta\beta$ при изменении Δl меняется незначительно ($\Delta\beta \leq 0,2\pi$). Соответственно, форма кривых в этом случае, как и следовало ожидать, меняется мало и близка к гауссовой (изменение ширины не более 20%).

Графики на рис. 3 рассчитаны для тех же значений параметров зеркал ИФП, что и кривые на рис. 1, б. Здесь, как видно из рис. 1, б, $\Delta\beta$ меняется в пределах резонансной кривой пропускания достаточно сильно, $\delta \sim \pi$, и поэтому профиль распределения $I(r)$ деформируется с перестройкой длины ИФП существенным образом.

Экспериментальное исследование предложенного метода проводилось на установке, созданной на основе Не-Не-лазера ($\lambda=0,63$ мкм). Неоднородное зеркало 5 (см. рис. 1) укреплялось на пьезокерамике и представляло собой подложку с расположенным на ней трехслойным диэлектрическим четвертьвольновым покрытием в виде четырех отражающих дисков диаметрами 0,16; 0,32; 0,61 и 0,85 мм. После напыления трехслойного отражающего покрытия вся поверхность подложки была просветлена. Коэффициент пропускания в пределах каждого диска $T_2'=0,6$, а вне его равен 1 и во всех экспериментах он оставался неизменным. Экспериментально измеренная начальная разность фаз δ , соответствующая геометрической толщине трехслойного покрытия, составила $(0,8 \pm 0,05)\pi$. Радиус сферического зеркала резонатора лазера (на рис. 1, а не показано) выбирался с таким расчетом, чтобы параметр w_0 гауссова пучка в плоскости зеркала 5 был больше радиуса диска. Изменения χ и η достигались сменой зеркала 4 и сферического зеркала лазера. Регистрация $I(r)$ осуществлялась в дальней зоне, имитированной с помощью дополнительного сферического зеркала, в фокусе которого располагались щель и ФЭУ. Более подробно описание и схема эксперимента приводятся в [5].

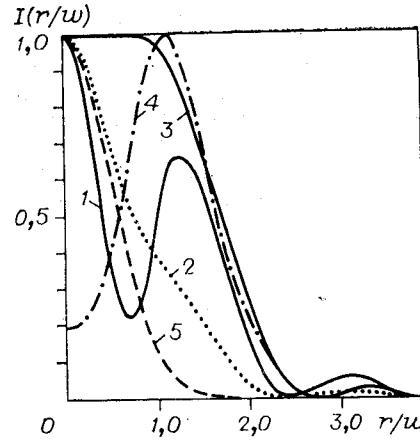


Рис. 3. Распределение интенсивности в дальней зоне для разных значений Δl

(случай $\eta=0,895$; $\delta=0,8\pi$; $T_1=0,003$; $T_2'=0,6$):
1 — $\Delta l=\pm 0,25 \lambda$, 2 — $\Delta l=-0,0705 \lambda$,
3 — $\Delta l=-0,00357 \lambda$, 4 — $\Delta l=0,0705 \lambda$, 5 —
гауссово распределение.

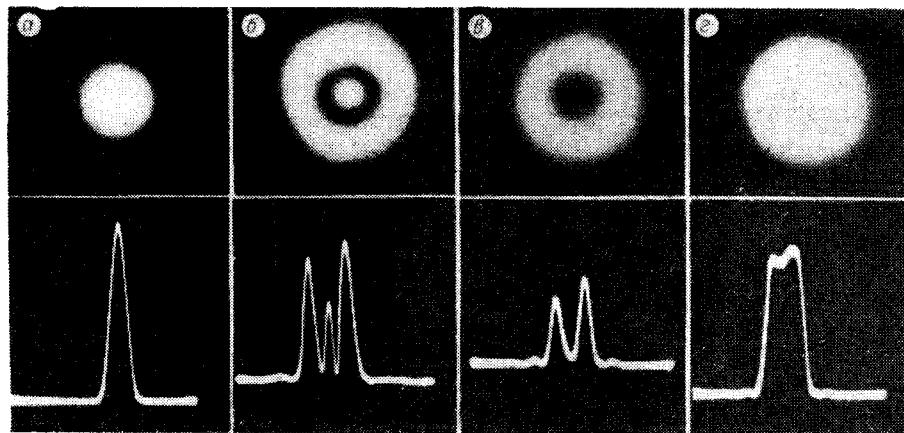


Рис. 4. Осциллографмы и фотографии распределения интенсивности лазерного пучка в дальней зоне.

При перестройке длины ИФП на $\lambda/2$ (чему соответствовало изменение напряжения U_k на пьезокерамике на 70 В) наблюдалось заметное изменение формы ДН. Представление об этом дают осциллографмы и соответствующие им фотографии $I(r)$, показанные на рис. 4. Рис. 4, а иллюстрирует ДН, полученную при $\Delta\beta = 0$, т. е. при выводе лазерного пучка через однородный ИФП (гауссово распределение). Три других снимка представляют наиболее характерные формы ДН при перестройке Δl на $\lambda/2$. Параметры зеркал ИФП и η в этом случае те же, что и для кривых на рис. 3.

Сравнение осциллографм и графиков на рис. 3 свидетельствует о хорошем качественном согласии экспериментальных и расчетных результатов. В частности, при некоторых Δl в эксперименте Δl не могло быть определено точно), как и следовало ожидать, получаются почти П-образные распределения (см. рис. 4, г) или распределения с провалом на оси пучка (см. рис. 4, б). Кроме того, следует отметить возможность существенного сужения ширины центрального лепестка и изменения уровня боковых лепестков ДН лазера (см. рис. 4, б).

На рис. 5 представлены в виде графиков результаты измерений параметров ДН для $\eta = 0,67$, $T_1 = 0,025$ и $T_2' = 0,6$. Штриховая прямая соответствует нормированной ширине гауссова пучка, измеренной по уровню 0,5; Δ_0 , Δ_1 — ширины центрального лепестка по уровню 0,5 и по положению первого нуля ДН; I_0 , I_1 — интенсивности центрального и боковых лепестков. Интенсивности даны в единицах $I_{1 \max}$, а Δ_0 и Δ_1 — в единицах $\Delta_{1 \max}$. Здесь $I_{1 \max}$ и $\Delta_{1 \max}$ — максимальные значения I_1 и Δ_1 . Из этих графиков видно, что для указанных значений параметров ИФП ширина центрального

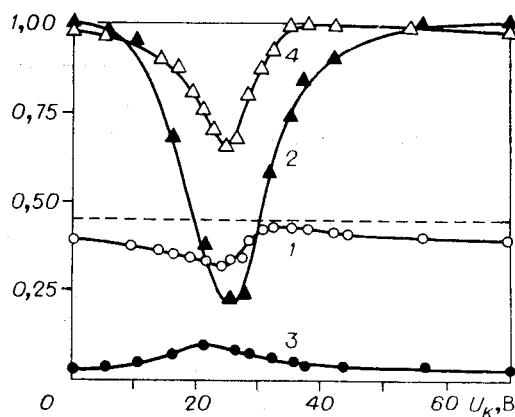


Рис. 5. Экспериментальные графики зависимости параметров ДН от напряжения на пьезокерамике:
1 — $\Delta_0/\Delta_{1 \max}$, 2 — $I_0/I_{1 \max}$, 3 — $I_1/I_{1 \max}$,
4 — $\Delta_1/\Delta_{1 \max}$.

лепестка Δ_0 и положение первого нуля Δ_1 меняются в $\sim 1,5$ раза (кривые 1, 4), интенсивность центрального лепестка I_0 — в ~ 5 (кривая 2), а боковых I_1 — в $\sim 3,3$ раза (кривая 3). При других значениях η , T_1 и T'_2 качественный ход кривых остается неизменным, а диапазон изменения величин может быть как больше, так и меньше. Например, для $\eta = 0,89$, $T_1 = 0,003$ и $T'_2 = 0,6$ изменением Δl ширина центрального лепестка может быть уменьшена в 3 раза по сравнению с шириной гауссова пучка.

Таким образом, результаты проведенных экспериментальных исследований и расчетов качественно согласуются между собой и позволяют сделать вывод о практической пригодности метода для управления ДН лазера в сравнительно широких пределах. Обращает на себя внимание разнообразие форм распределений, которые могут быть получены таким путем. В частности, как было показано выше, получаются лазерные пучки с почти П-образным профилем интенсивности и с профилем, имеющим провал в центре, который при определенных условиях доходит до нуля. Кроме того, возможно получение ДН с относительно малой шириной центрального лепестка. Для ряда приложений (связь, локация, передача световой энергии на дальние расстояния) получение таких пучков представляет несомненный интерес [6—8].

В отличие от стандартных устройств активной оптики, модулирующих только фазу луча по волновому фронту, в этом методе меняется и фаза, и амплитуда. Это позволяет заходить в область параметров ДН, которая недоступна для чисто фазовой модуляции. Отсутствие бесполезных потерь энергии лазерного пучка является также существенным достоинством данного метода.

Быстродействие метода определяется инерционностью сканирующего элемента и в нашем случае составляло несколько миллисекунд. Оно существенно увеличится, если вместо пьезокерамики использовать для модуляции оптической длины интерферометра какой-либо подходящий электрооптический кристалл (например, KDP).

Вопросы быстродействия, стабильности ДН во времени и динамического диапазона метода имеют важное значение для приложений. Однако изучение их выходит за рамки настоящей работы. Несомненно, для получения высокой стабильности ДН необходимо применять в качестве базы интерферометра материал с малым коэффициентом теплового расширения (кварц, ситалл и т. п.).

В заключение отметим, что предлагаемый метод пространственной амплитудно-фазовой модуляции может быть использован для управления ДН лазера, работающего не только на основной гауссовой mode, но и на поперечных модах более высокого порядка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Харди Дж. У. Активная оптика: Новая техника управления световым пучком.— ТИИЭР, 1978, т. 66, № 6.
2. Троицкий Ю. В. Равномерное освещение при помощи газового лазера.— Опт. и спектр., 1974, т. 37, вып. 5.
3. Розенберг Г. В. Оптика тонкослойных покрытий. М.: Физматгиз, 1958.
4. Olaofe G. O. Diffraction by Gaussian Apertures.— JOSA, 1970, vol. 60, N 12.
5. Кольченко А. П., Никитенко А. Г., Троицкий Ю. В. Управление диаграммой направленности лазера при помощи интерферометра Фабри — Перо с неоднородным зеркалом.— В кн.: Тез. докл. I Всесоюз. конф. «Проблемы управления параметрами лазерного излучения. (Ташкент, 1978)». Ташкент: изд. ТашГУ, 1978, ч. 1, с. 95—99.
6. Смит Д. К. Распространение мощного лазерного излучения. Тепловое искажение пучка.— ТИИЭР, 1977, т. 65, № 12.

7. Карамзин Ю. Н., Сухоруков А. П. Нелинейная адаптивная оптика.— Изв. АН СССР. Сер. физ., 1978, т. 42, № 12.
8. Волохатюк В. А., Кочетков В. М., Красовский Р. Р. Вопросы оптической локации. М.: Сов. радио, 1977.

*Поступила в редакцию 6 сентября 1979 г.;
окончательный вариант — 17 декабря 1979 г.*

УДК 681.327.68 : 621.383

С. И. НАЙМАРК
(Новосибирск)

**НЕКОТОРЫЕ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ
И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ
МДП-ФОТОДИОДНЫХ УСТРОЙСТВ**

Со времени первых работ Веймера [1] интегральные многоэлементные фоточувствительные устройства, в особенности МДП-фотодиодные, за-воевали признание разработчиков электронной аппаратуры. Однако известные устройства чаще всего представляют собой безвакуумные аналоги телевизионной трубки в том смысле, что считывание исходной функции $g(x, y)$, проецируемой в виде изображения на фоточувствительное устройство, осуществляется путем последовательного сканирования или поэлементной (ячейка за ячейкой) выборки информации. В то же время ясно, что реализуя выборку с определенным алгоритмом, можно осуществлять предобработку изображения. Поскольку подавляющее большинство алгоритмов обработки изображений сводится к интегральным преобразованиям, большой интерес представляет совмещение функций считывания и предобработки с целью увеличения быстродействия преобразования. Некоторые аспекты такого подхода развиты авторами работ [2, 3] применительно к преобразованию Уолша.

Представляет интерес реализация выборки с произвольным алгоритмом в МДП-фотодиодных устройствах, которые изготавливаются в стандартном МДП-технологическом процессе и широко распространены. При такой выборке выходной сигнал на каждом такте будет являться линейной комбинацией сигналов фотоячеек с весами $\{0, 1\}$, а процесс выборки описывается линейным преобразованием

$$\mathbf{F} = \mathbf{HG}, \quad (1)$$

где \mathbf{G} — вектор, составленный из отсчетов изображения $g(x, y)$, проецируемого на фоточувствительное устройство; \mathbf{H} — матрица преобразования, состоящая из нулей и единиц.

Критериями оценки качества преобразования могут служить такие характеристики, как отношение сигнал/шум и ограничение на объем передаваемой информации на выходе фоточувствительного устройства, которые будут зависеть от схемы фотоячеек, режима ее работы и структурной организации фотоячеек в линейку или матрицу.

Пусть имеется ограничение Θ на длительность экспозиции и выборки сигналов, эквивалентное длительности телевизионного кадра. В течение интервала времени Θ изображение $g(x, y)$ дискретизируется и представляется конечным множеством отсчетов G , число которых равно числу фотоячеек M в фоточувствительном устройстве. Информация об отсчетах